

High-Speed Laser Scanning System

平面基板検査装置 LSI-series

用途に合わせた設計で、多様なニーズにお答えします。



LSI/RSI series (標準機)

微分干渉付顕微鏡、マーキング機能、
検査結果照合機能 付き

- 基 板: サイズ、材質、透明、不透明
- 検出サイズ: ご要望に応じてカスタマイズ
- 欠 陥 種: 異物、キズ、ウネリ など

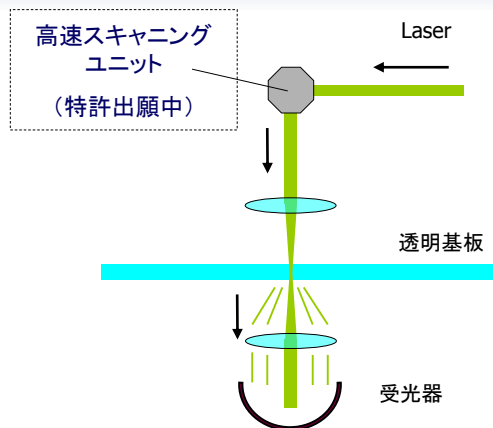
- 様々な解析器機とパッケージング可能
- 標準仕様から特注仕様まで
- Stand-aloneからFA化まで

まずはご相談ください。

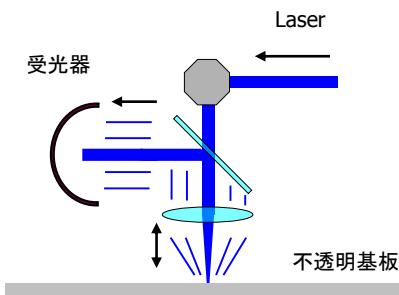
SSC System Seiko

Customization

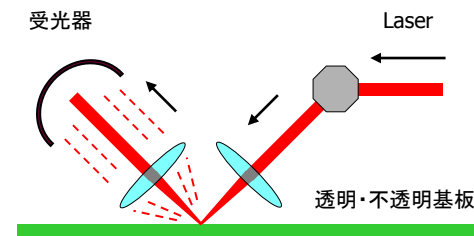
【透過型】LSI-T750X



【反射型】LSI-R500X



【斜反射型】LSI-W750X



LSI-T750X	
Laser	λ560nm/50mW
走査幅	75mm
トラック	0.025mm
送り速度	10mm/s max.
検出能力	0.6μm (PSL)
検出欠陥	異物、キズ、内泡など
検査時間	112s /12"wafer

LSI-R500X	
Laser	λ488nm/50mW
走査幅	50mm
トラック	0.015mm
送り速度	6mm/s max.
検出能力	0.6μm (PSL)
検出欠陥	異物、キズ など
検査時間	260s /12"wafer(片面)

LSI-W750X	
Laser	λ633nm/7-10mW
走査幅	75mm
トラック	0.050mm
送り速度	20mm/s max.
検出能力	H17 Å /W0.1mm(10 ^{-3°})
検出欠陥	微小ウネリ、異物 など
検査時間	56s /12"wafer(片面)

※) 各表の仕様は代表例です。

お問い合わせ

システム精工株式会社

<http://www.systemseiko.co.jp>

〒940-1164 新潟県長岡市南陽2丁目951-6

TEL: 0258-22-1322 FAX: 0258-22-0185

E-mail: product@systemseiko.co.jp

SSC System Seiko